用时间分辨法实现半导体激光器 特性脉冲测试

左勇¹,范贤光²,孙颖¹

(1. 中航工业北京长城计量测试技术研究所,北京 100095; 2. 厦门大学 物理与机电工程学院,福建 厦门 361005)

摘 要:提出了一种基于时间分辨的脉冲式半导体激光器特性测试新方法,并研制了相应的测试系统。该方 法根据脉冲驱动源的时序,同步产生采样窗口信号,然后根据采样窗采集半导体激光器的注入电流、端电压和输 出光功率等数据,进而获得表征器件特性的曲线和参数。该方法解决了半导体激光器特性测试中的2个关键问题: 一是现有的连续测试方法造成的器件温升,影响测试准确性和安全性;二是解决了脉冲驱动源与测试的同步问题。文中给出了最小脉冲宽度达 100 ns 的窄脉冲驱动的 L-I-W 测试曲线和测试参数。

关键词:半导体激光器;脉冲测试;时间分辨;特性 中图分类号:TN248.4 文献标识码:B 文章编号:1674-5795 (2012) 03-0043-04

Implementation of Laser Diode Characteristics Pulsed Testing by Time-resolved Technique

ZUO Yong¹ , FAN Xianguang² , SUN Ying¹

(1. Changcheng Institute of Metrology & Measurement , Beijing 100095 , China;

2. Dept. of Physics and Mechanical-Electrical Engineering , Xiamen University , Xiamen 361005 , China)

Abstract: A new method to test pulsed laser diode characteristics based on time-resolved technique is presented , and the testing system is developed. Sampling window is made according to the timing of the pulsed current source. Using a synchronized sampling scheme , the injected current , the forward voltage and the optical output power are gathered , and then the curves and parameters are obtained. The rising of laser diode chip temperature under test is reduced , and the synchronization for pulsed current source and testing is resolved by this method. Based on the setup , *L*-*I*-*V* curves and related parameters of a laser diode were tested with pulsed injection of 100ns.

Key words: laser diode; pulsed testing; time-resolved; characteristics

0 引言

半导体激光器具有体积小、能够直接调制、输入 功率小、寿命长以及转换效率高等优点,已经作为一 种重要的光电器件,广泛应用于测量、信息存储及通 信等领域^[1-2],而其质量和可靠性在应用系统中起着 关键作用。半导体激光器从棒料、管芯到组件装配的 各个阶段,都需要对器件进行严格的测试,以提高器 件的成品率和质量。

用于表征半导体激光器性能最主要的方法是测试 器件的光功率 – 电流 – 电压(*L-I-V*)特性。半导体激 光器驱动方式分为连续和脉冲两种,同样,特性测试 方法也分为连续测试^[3-4]和脉冲测试^[5-6]两种。在脉冲 驱动下,半导体激光器处于发热和散热交替过程,当 脉冲占空比足够小时,不会造成大的热积累或大的温 升,然而激光器处于高速的调制状态,注入的脉冲电 流、端电压和输出的光功率随时间为窄脉冲形状,需 要考虑如何准确、同步的获取有效数据。此外,为了 减小激光器的持续工作时间,还要求脉冲宽度尽可能 小。脉冲测试,在窄脉冲驱动电流源,数据同步采集 等方面提出了更多挑战。

本文提出了一种基于时间分辨的脉冲式半导体激 光器特性测试方法,并建立了相应的脉冲测试系统, 实现了窄脉冲源与测试的同步,满足了半导体激光器 脉冲测试的需要。

1 测量原理

图 1 给出了时间分辨^[7]技术基本原理图,其中驱动电流 *I*、结温 *T*、端电压 *V*、光功率 *L*(或 *P*)和采样

收稿日期: 2012-02-14; 收修改稿日期: 2012-04-24 基金项目: 国家"十一五"计量科研计划项目资助(J052009B002) 作者简介: 左勇(1980-),男,工程师,工学硕士,主要从事 自动化测试与控制及测试计量技术方面的研究工作。

窗是在同一时间基准轴上的轮廓曲线图。在脉冲式半 导体激光器特性测试时,将一串脉冲宽度为 T_w 、脉冲 间隔时间为 T_i 、峰值电流为 I_p 、按照步幅 I_{step} 增加的脉 冲电流注入到器件的有源区。在单脉冲注入 T_w 期间, 激光器有源区产生热量,结温随着脉冲的持续时间而 增加,加热时间 $T_h = T_w$,同时造成器件特性发生变化, 端电压和输出光功率减小。当单脉冲结束时,器件处 于散热阶段,通过热交换达到环境温度,散热时间 T_c = T_i 。数据采集系统根据采样窗设定的采样窗口 T_g , 同步采集注入的驱动电流I、端电压V和输出光功率L数据。计算机的测试程序根据这些数据,进行处理后, 获得器件的特性曲线和参数。



图1 时间分辩技术原理图

利用时间分辨技术的脉冲注入测试方法,一方面 有效的抑制了有源区的温升,另一方面保证有效数据 的获取。实际测试时,希望驱动电流的脉冲宽度尽可 能窄,这样激光器持续工作的时间就会相对短些。此 外,要求脉冲间隔时间足够长,以确保下一个电流脉 冲到来之前,有源区的温度恢复到环境温度。

2 测试系统

根据时间分辨技术原理,要测试半导体脉冲激光器的 L-I-V 特性(包括 V-I,L-I 和 I_m-I 等),首先要使得被测激光器处于脉冲发光状态下。因此,除了测量装置外,还需要脉冲驱动电流源,温控装置是为能够对激光器进行温度控制的场合而准备的,如集成有

TEC 的半导体激光器组件。图 2 是测试系统总体结构 图,整个测试系统包括模拟单元、数字控制与测试单 元和计算机软件部分。图中脉冲发生器产生脉冲宽度 为 T_w、脉冲间隔时间为 T_i 的基准方波信号,用于控制 脉冲驱动输出接口的高速开关,并将恒流源转化成脉 冲电流源; 同时,脉冲发生器产生与基准方波信号同 步的采样窗信号,用于控制高速采样保持器,实现脉 冲驱动电流 I、背光电流 I_m、端电压 V 和输出光功率 L 等数据的同步采集。热电制冷器(TEC) 用于控制 被测激光器的温度; 激光器在脉冲电流源驱动下发出



图 2 测试系统结构图

脉冲激光,前后端面分别采用探测器进行光功率测量,其中前端面经由积分球衰减后,由光纤耦合到探测器。

3 脉冲发生器

脉冲发生器产生两路同步的矩形脉冲信号,一路 是基准方波脉冲,另一路是采样窗口脉冲。为了满足 半导体激光器特性表征测试的需要,要求基准方波的 脉冲占空比连续可调,采样窗口脉冲能够同步跟随基 准方波脉冲,且采样窗的位置位于基准方波脉冲宽度 50%之后。基于 FPGA 设计实现了脉冲发生器,其硬件 描述语言程序流程图如图 3 所示。

同时,为了满足单点测试的要求,脉冲发生器还 具备单脉冲产生功能,即产生同步的基准方波和采样 窗口单脉冲信号。



4 测试实验与结果

4.1 器件特性测试

根据时间分辨技术原理,利用所研制半导体激光 器特性测试系统,对半导体激光器特性进行脉冲驱动 和测试。计算机的应用程序通过 USB 接口与测试系统 通讯,测试时,根据被测器件的功率设定各种条件, 如驱动电流(DC或脉冲)、驱动模式(ACC或APC)、 驱动电流范围、步幅以及脉冲宽度、脉冲周期和采样 窗等。测试结束后,应用程序接收数字控制与测试单 元传递过来的各种数据,包括工作电流、端电压、输 出光功率和背光电流等,对这些数据进行处理(平滑、 拟合和微分等),之后给出特性曲线。图4给出了一个 中心波长为 850 nm 的小功率半导体激光器(LD) 特性 测试曲线(室温下),其测试条件如表1所示。图4 中, I_f, V_f分别表示注入半导体激光器的脉冲电流、电 压幅值的大小。根据测量数据及测量曲线,可以求解 得到被测 LD 的主要技术参数,包括阈值电流、串联电 阻和斜率效率,如表2所示。

表1 测试条件设定

驱动	控制	电流	步	脉	周	采样
模式	方式	范围/mA	幅/mA	宽/ns	期/ns	窗/ns
Pulsed	ACC	$0 \sim 20$	0.1	100	200	50
表 2 被测 LD 的主要技术参数						
驱动	波	阈值	串	联	斜率	
模式	₭/nm	电流/mA	4 电阻	1/Ω 效率/(″ • A ⁻¹)
Pulsed	850	10.55	5. ()24	0. 146	



图 4 半导体激光器特性曲线

4.2 脉冲宽度与周期对特性的影响

在室温环境下,脉冲周期10 ms(两个电流脉冲之间具有充足的时间,在一个脉冲结束后,下一个脉冲到来时,激光器有源区的温度与环境温度相同),采样窗设为50 ns,测试不同的脉冲宽度下某激光器输出光功率可见,随着脉冲宽度的减小,激光器的转换效率增大(*L-I*特性曲线的斜率越大),如图5所示。



图 5 DC 和脉冲(脉冲周期 *T* = 10 ms, *T*_w分别为 100 ns 及 1, 10 μs) 情况下,激光器 *L-I* 特性测试曲线

其原因是脉冲宽度越大,激光器持续工作时间越 长,有源区的热积累越多,温升越大。同样,当脉冲 宽度不变,脉冲间隔时间从小到大改变时,激光器的 转换效率也将逐渐增大,直到达到一个临界状态,此 后,激光器的转换效率将保持不变,此时,每个电流 脉冲结束后,在下一个电流脉冲到来时,有源区的温 度都和热沉温度相同。

5 结论

半导体激光器的 L-I-V 特性是决定其性能的重要指标之一。基于时间分辨技术原理测试激光器的 L-I-V 特性时,当脉冲电流的占空比足够小时,可以忽略管芯温度升高的影响,使测试结果更加准确地反映 LD 的性能,提高了测试的准确性。该方法可以对中小功率 LD 进行安全、快速和准确的 L-I-V 特性及参数测试,满足激光器生产和科研的需要。

参考文献

[1] 王德,李学千.半导体激光器的最新进展及其应用现状 [J].光学精密工程,2001,9(3):279-283.

[2] 尧舜, 套格套, 路国光, 等. 68.5 W 连续输出 1060 nm 波

段半导体激光列阵模块 [J] . 光学 精密工程, 2006, 14 (1): 8-11.

- [3]杨明伟, 许文海, 顾慧萍. 融入 FPGA 技术的半导体激光器 功率-电流-电压测试系统[J].光电子·激光, 2005, 16 (3): 344-348, 353.
- [4] 陈汉汛,吉孔武,徐达伟,等.LD 自动测试系统的研制与 开发 [J].武汉理工大学学报:信息与管理工程版,2001, 23 (3):4-6.
- [5] 南矿军. 半导体激光器性能表征及脉冲测量技术研究[D].北京: 中国科学院, 2002.
- [6] 许文海,董丽丽,张勋. 便携式多功能 LD 特性测试系统的 研制 [J]. 光电子・激光,2007,18 (3): 356-358.
- [7] HU M H , WATERS R , ZAH C Z. Determining kinks for 980 nm laser using time-resolved far-field scan [J]. SPIE , 2001 , 4580: 41 – 55.

(上接第19页)



图 5 分离趋势项后总误差数据的小波变换分解结果

用希尔伯特-黄变换对一个混联式动态测量系统仿真的 总误差信号进行了分解。与傅立叶变换、小波变换的 分解结果相比,希尔伯特-黄变换的分解结果更准确。 这对动态测量系统地误差溯源,进而指导仪器优化设 计具有重要的意义。

参考文献

- [1] 费业泰.精度理论若干问题研究进展与未来 [J].中国机 械工程,2000,11(3):255-274.
- [2] 李龙根,徐静,吕秀丽.测量与控制系统动态误差溯源熵
 方法[J],机电产品开发与创新,2005,18(6):115
 -135.

- [3] 李晓惠. 动态测量误差分解及溯源研究 [D]. 合肥: 合肥 工业大学, 2006: 50-60.
- [4] 马强, 许桢英. 动态测量误差溯源方法研究 [J]. 安徽机 电学院学报, 2001, 16 (4): 22 – 25.
- [5] 许桢英,费业泰.基于小波神经网络的动态测试误差溯源 研究[J].农业机械学报,2003,34(4):117-119.
- [6] Lippmann R . An Introduction to Computing with Neural Nets[J] . IEEE ASSP Magazine , 1987 , 4 (2): 4 22.
- [7] 钟珞, 饶文碧. 邹承明. 人工神经网络及其融合应用技术[M]. 北京: 科学教育出版社, 2007: 21-25.
- [8] Sawicki Jerzy T, Sen Asok K, Litak Grzegorz. Multiresolution wavelet analysis of the dynamics of a cracked rotor [J]. International Journal of Rotating Machinery, 2009 (2009): 1-8.
- [9] Huang N E , Shen Z , Long S R , et al. The empirical mode decomposition and the Hilbert spec – trum for nonlinear and nonstationary time series analysis [J] . Proc. R. Soc. Lond. A , 1998 , 454 : 903 – 995.
- [10] 余慧,胡绍林,李平.基于希尔伯特-黄变换的雷达数据 误差修正处理技术 [J],中国空间科学技术,2010(6): 57-63.
- [11] 陈晓怀,费业泰,黄强先.全系统动态测量精度理论的基本问题[J].制造业自动化,1999,21(6):46-51.
- [12] Braun S , Feldman M. Decomposition of non-stationary signals into varying time scales: Some aspects of the EMD and HVD methods [J]. Mechanical Systems and Signal Processing, 2011, 25 (7): 2608 – 2630.